

# DIN 32567-2:2014-10 (D)

## Fertigungsmittel für Mikrosysteme - Ermittlung von Materialeinflüssen auf die optische und taktile dimensionelle Messtechnik - Teil 2: Prüfkörper für taktile Verfahren

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>	<b>3</b>
<b>Einleitung .....</b>	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich .....</b>	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Begriffe .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Anforderungen an die Prüfkörper.....</b>	<b>5</b>
<b>4.1 Allgemeines .....</b>	<b>5</b>
<b>4.2 Anforderungen an die Abmessungen der Schicht .....</b>	<b>5</b>
<b>4.2.1 Mindestschichtdicke, -länge und -breite.....</b>	<b>5</b>
<b>4.3 Anforderungen an Ebenheit, Welligkeit und Rauheit von Schicht und Substrat .....</b>	<b>7</b>
<b>4.3.1 Allgemeines .....</b>	<b>7</b>
<b>4.3.2 Konstanz der Schichtdicke .....</b>	<b>7</b>
<b>4.3.3 Ebenheit des Substrates .....</b>	<b>7</b>
<b>4.3.4 Welligkeit des Substrates .....</b>	<b>8</b>
<b>4.3.5 Rauheit des Substrates.....</b>	<b>8</b>
<b>5 Prüfkörper für topografische Schichtdickenmessungen.....</b>	<b>8</b>
<b>5.1 Allgemeines .....</b>	<b>8</b>
<b>5.2 Messverfahren .....</b>	<b>9</b>
<b>5.3 Prüfkörper A.....</b>	<b>10</b>
<b>5.3.1 Allgemeines .....</b>	<b>10</b>
<b>5.3.2 Schichtsysteme der Testobjekte .....</b>	<b>10</b>
<b>5.3.3 Referenzobjekte.....</b>	<b>12</b>
<b>Literaturhinweise.....</b>	<b>13</b>